

低温成膜に特化したDLC成膜小型プラズマCVD装置

<p>概要 ・ 品質 ・ 性能</p>	<p>樹脂・繊維製品等を対象とした低温成膜に特化し、また塩化ビニル製チャンバーを用いることで、従来品に比べ小型・軽量・安価な DLC 成膜装置。 電源に 27MHz の高周波電源装置を用い、電極間距離が近傍した電極構造により高密度プラズマを形成。これにより成膜ガスを高度プラズマ化しパルス電圧を印加することで 50℃以下での成膜を可能にし、これまでの高温成膜では困難であった素材に対応する。短い処理時間で一般的な DLC 膜と同一の膜特性の DLC 膜を成膜でき、抗菌性 DLC 膜の成膜も可能。希望価格は 1 台 2000 万円。 URL http://www.sankyo-seisakusho.co.jp/</p>	 <p>布形状の平面状態への加工用の電極</p>  <p>球面形状への加工用の電極</p> 
<p>用途</p>	<p>(1)防汚・離形成・耐腐食性向上が要求される樹脂製品(水廻りのPP樹脂、印刷機ヘッド、半導体フレキシブル基盤等) (2)撥水性・抗菌性の付与(布、繊維製品 他)</p>	<p>技術移転</p> <p>(1)形態：共同研究開発、製品の供給 (2)相手先：中堅企業 (3)地域：国内に限る</p>
<p>実用化・情報</p>	<p>[試作・実験] 完了 [製造・販売実績] 無し [技術情報の提供] パンフレット、サンプル [情報提供者] ㈱三共製作所 ナノテク素材ユニット 増子貞光 [連絡先](公財)りそな中小企業振興財団 TEL:03-3444-9541 FAX:03-3444-9546</p>	<p>特許等</p>